

SEMI D42-0308

SPECIFICATION FOR ULTRA LARGE SIZE MASK SUBSTRATE CASE

超大型マスク基板材料（収納用）ケースの仕様

NOTICE: This translation is a REFERENCE COPY ONLY. If differences should exist between the English version and a translation in any other language, the English version is the official and authoritative version.

免責事項： この SEMI スタンドアードは、投票により作成された英語版が正式なものであり、日本語版は日本の利用者各位の便宜のために作成したものです。万が一英語と日本語とに差異がある場合には英語版記載内容が優先されます。

SEMI スタンドアード日本語翻訳版をご利用にあたっての注釈を本文の末尾に記載しております（「すべきである」「しなければならない」について等）。

本スタンドアードは、Flat Panel Display – Mask Global Technical Committee で技術的に承認されている。現版は 2007 年 12 月 5 日、global Audits and Reviews Subcommittee にて発行が承認された。2008 年 3 月に www.semi.org で。初版は 2005 年 3 月に発行された。

1 目的

1.1 本スタンドアードでは、LCD 製造プロセスで用いられる、超大型マスク基板材料（収納用）ケースの仕様を規定する。

2 範囲

2.1 本スタンドアードで規定する仕様は、LCD 製造プロセス用マスクを作成するときに用いられる基板材料を収納する際に使用されるケースに適用されるものとする。本スタンドアードで規定されるマスクに対応する基板サイズは、850 mm × 1,200 mm 以上とする。

2.2 基板の大型化に伴い、マスク基板の自動ハンドリングが避けられなくなる。本仕様では、（収納用）ケース内でのマスク基板のハンドリング領域を規定する。

注意： このスタンドアードおよび安全ガイドラインはその使用に関連した全ての安全上の問題を取り扱うことを意図していない。この文書の使用者は、その責任において、適切な安全および健康上実施すべき事項を決定し、また使用前に法規制やその他の制限への適用性を判断するものである。

3 参照スタンドアードおよび文書

3.1 なし。

注意： 別途指示のない場合、引用された全ての文書は最新版を指す。

4 用語

4.1 定義

4.1.1 ケース (case) — マスク基板を 1 枚収納するための、密閉できる容器 (Container)。

5 要求事項

5.1 LCD 製造プロセス用超大型マスク基板のハンドリング領域。

5.1.1 図 1 の斜線部分を、LCD 製造プロセス用超大型マスク基板のハンドリングのための排除領域としなければならない。

5.1.2 図 1 で使用されている記号は、表 1 の規定通り。

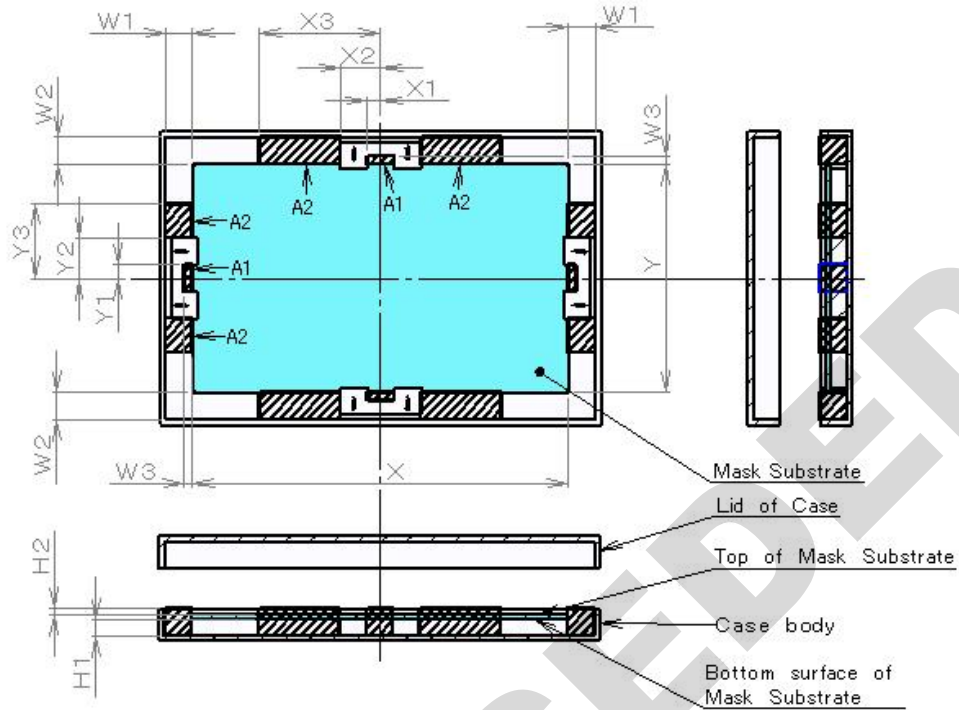


図 1

LCD 製造プロセス用超大型マスク基板のハンドリング領域（マスク基板保持状態）

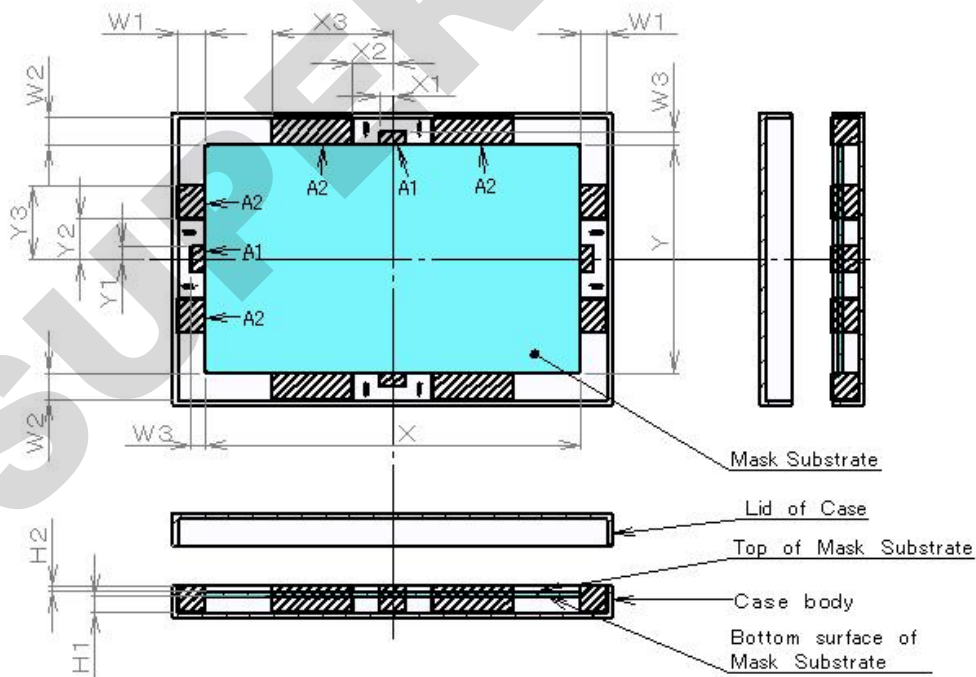


図 2

LCD 製造プロセス用超大型マスク基板のハンドリング領域（マスク基板保持部解放状態）